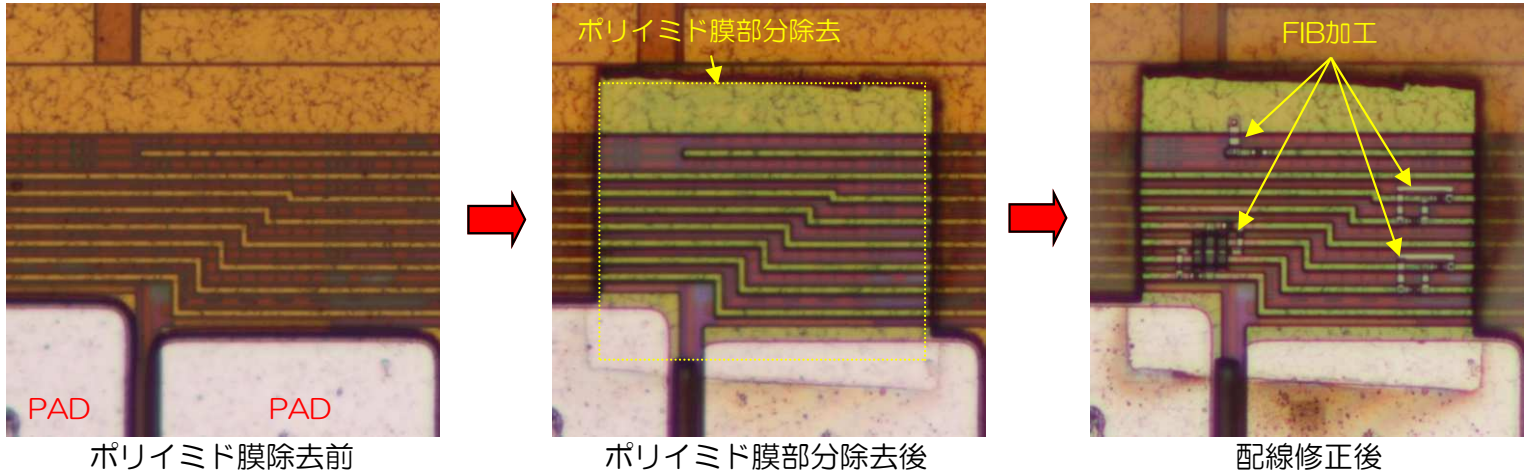


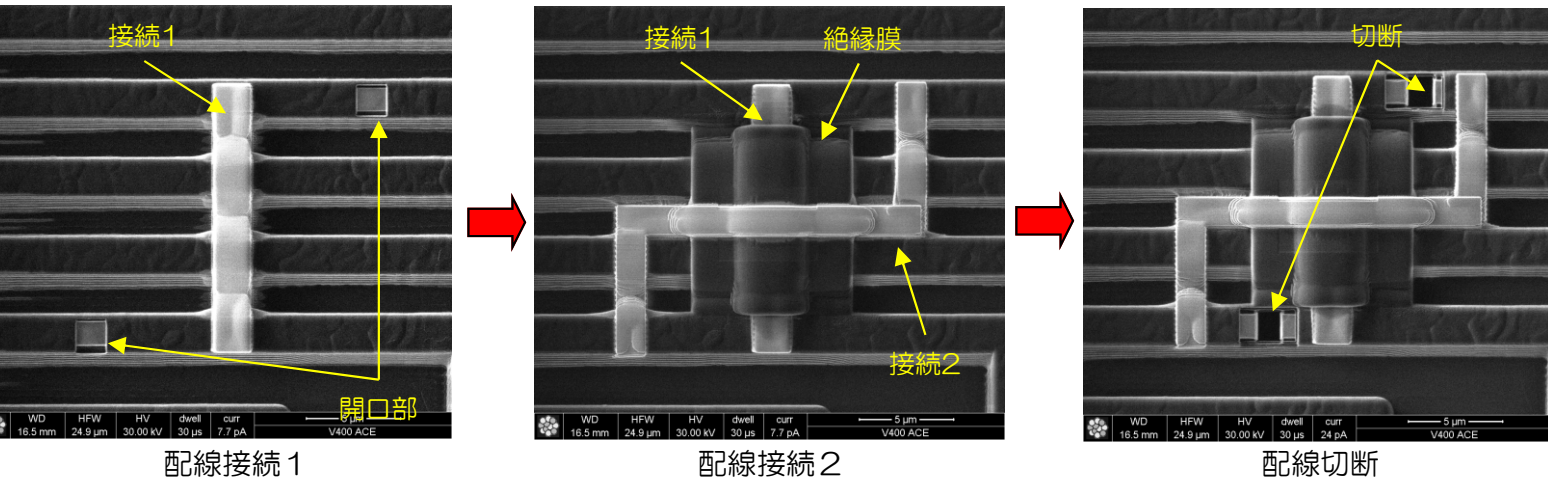
【1】 ポリイミド膜部分除去

■レーザーでポリイミド膜 (PIQ膜) を部分除去することで、短TAT且つ高歩留まりの配線修正が可能です。



【2】 絶縁膜を用いた配線修正

- 接続配線の上に絶縁膜を作膜することで、交差した配線修正が可能です。
- 切断箇所に絶縁膜を埋め込むことで、腐食によるリーク電流を防止します。



【3】 ハイアスペクトの加工

■ハイアスペクトのエッチングおよび金属埋め込み加工が可能です。

